# **BEST AVAILABLE COPY**

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-255695

(43) Date of publication of application: 11.09.2002

(51)Int.Cl.

C30B 29/40

G11B 11/105

(21)Application number : 2001-059195

(71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY

CORP

(22)Date of filing:

02.03.2001

(72)Inventor: YOSHIDA HIROSHI

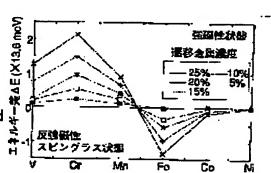
SATO KAZUNORI

## (54) FERROMAGNETIC GROUP III-V COMPOUND AND CONTROLLING METHOD FOR THE FERROMAGNETIC CHARACTERISTICS THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide ferromagnetic group III-V compounds in which ferromagnetism can be obtained by using the group III-V compounds (GaAs, InAs, GaP, InP) transmitting light, and a method for controlling the ferromagnetic properties of the ferromagnetic group III-V compounds.

SOLUTION: At least one kind of transition metal selected from the group consisting of V and Cr substitutes for the group III elements in the group III-V compounds to form mixed crystals. Then, the ferromagnetic properties thereof are controlled by the addition of antiferromagnetic transition metals such as Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Rh, Ru or the like, the addition of dopants, and the control of the concentration of the transition metals.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

18.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-255695

(P2002-255695A)

(43)公開日 平成14年9月11日(2002.9.11)

(51) Int.Cl.7		酸別記号	FΙ	テーマコード( <del>容考</del> )
C30B	29/40		C30B 29/40	A 4G077
G11B	11/105	506	G11B 11/105	506Z 5D075

#### 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

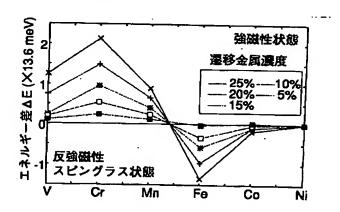
(21)出願番号	特顧2001-59195(P2001-59195)	(71)出顧人 396020800
		科学技術振興事業団
(22)出願日	平成13年3月2日(2001.3.2)	埼玉県川口市本町4丁目1番8号
		(72) 発明者 吉田 博
		兵庫県川西市大和東2丁目82番4号
		(72)発明者 佐藤 和則
		大阪府箕面市牧務5丁目2番36号 第1福
		和莊A-12
		(74)代理人 100108671
		弁理士 西 義之
		Fターム(参考) 40077 AA03 BE43 BE44 BE45 BE46
		DA05 DB08 EB02 HA03
		5D075 FF01 GG02 GG12 GG16

#### (54) 【発明の名称】 強磁性 I I I - V 族系化合物及びその強磁性特性の調整方法

#### (57)【要約】

【課題】 光を透過する I I I-V族系化合物 (GaAs, I nAs, GaP, InP) を用いて強磁性が得られる強磁性 I I I-V族系化合物の提供、およびその強磁性特性を調整することができる強磁性 I I I-V族系化合物の強磁性特性を調整する方法を提供する。

【解決手段】 VまたはCrよりなる群から選ばれる少なくとも1種の遷移金属がIII-V族系化合物のIII 族元素を置換して混晶を形成する。そして、Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Rh, またはRuなどその他の反強磁性の遷移金属の添加、ドーパントの添加などやこれらの遷移金属の濃度の調整、により強磁性特性を調整する。



10

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 GaAs, InAs, InP, またはGaPよりなる群から選ばれるIII-V族系化合物において、VまたはCrよりなる群から選ばれる少なくとも1種の遷移金属がIII族元素を置換して混晶を形成してなることを特徴とする単結晶強磁性-V族系化合物。

【請求項3】 n型ドーパントまたはp型ドーパントの少なくとも一方がドーピングされてなることを特徴とする請求項1または2記載の強磁性III-V族系化合物。

【請求項4】 GaAs, InAs, InP, またはGaPよりなる群から選ばれる I I I - V族系化合物に、(1)VまたはCrよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の遷移金属元素(2)前記(1)の遷移金属元素、およびTi, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Rh, またはRuよりなる群から選ばれる少なくとも1種のその他の遷移金属元素、または(3)前記(1)または(2)の遷移金属元素と、n型ドーパントまたはp型ドーパントの少なくとも一方、のいずれかを添加し、前記(1)、(2)、または(3)の元素の添加濃度の調整により強磁性特性および/または強磁性転移温度を調整することを特徴とする強磁性 I I I - V族系化合物の強磁性特性の調整方法。

【請求項5】 GaAs, InAs, InP, またはGaPよりなる群から選ばれる I I I - V族系化合物に、(1) VまたはCrよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の遷移金属元素(2)前記(1)の遷移金属元素、およびTi, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Rh, またはRuよりなる群から選ばれる少なくとも 1 種のその他の遷移金属元素、のいずれかを添加し、これらの添加金属元素の組合せにより強磁性特性および/または強磁性転移温度を調整することを特徴とする強磁性 I I I - V族系化合物の強磁性特性の調整方法。

【請求項6】 前記(2)の遷移金属元素を混晶させ、強磁性のエネルギー状態を調整するとともに、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子による運動エネルギーによって全エネルギーを低下させることにより、強磁性状態を安定化させることを特徴とする請求項4または5記載の調整方法。

【請求項7】 前記(2)の遷移金属元素を混晶させ、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子によって、金属原子間の磁気的相互作用の大きさと符号を制御することにより、強磁性状態を安定化させることを特徴とする請求項4または5記載の調整方法。

【請求項8】 前記(2)の遷移金属元素を混晶させ、該金属元素自身により導入されたホールまたは電子によって、金属原子間の磁気的相互作用の大きさと符号を制御するとともに、該金属元素の混晶による光の透過特性を制御することにより、所望の光フィルタ特性を有する強 50

磁性 I I I-V族系化合物とすることを特徴とする請求項4または5記載の調整方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、III-V族系化合物において強磁性特性を実現させた単結晶の強磁性III-V族系化合物および該化合物の強磁性特性の調整方法に関する。

[0002]

【従来の技術】光を透過しながら高い強磁性特性を有する単結晶の強磁性薄膜が得られれば、大量の情報伝達に必要な光アイソレータや光による高密度磁気記録が可能になり、将来の大量情報伝達に必要な電子磁気材料を作製することができる。そのため、光を透過し、かつ強磁性を有する材料が望まれている。

【0003】III-V族系化合物は、赤色から紫外の 波長の光でも透過するという性質を有し、この材料で高 い強磁性転移温度を持つ強磁性が得られればコヒーレン トなスピン状態を利用した光量子コンピュータなどの光 デバイス作製のために大きな発展が期待される。

【0004】しかし、従来は、III-V族系化合物にMnをドープした例はあるが強磁性転移温度(キューリー点)が100°K程度と低く、高いキューリー点をもつIII-V族系化合物の強磁性状態の実現は報告されていない。

[0005]

30

【発明が解決しようとする課題】前述のように、III -V族系化合物を用いて安定した強磁性特性が得られれば、その化合物をエキシトンの結合エネルギーが大きいIII-V族系化合物からなる半導体レーザなどの発光素子と組み合わせて利用することができたり、磁気状態を反映した円偏光した光を発生させることができ、磁気光学効果を利用する磁気光学スピンデバイス開発のために用途が非常に大きくなる。

【0006】さらに、前述のような光を照射し、磁化状態を変化させることにより、強磁性体メモリを構成する場合、強磁性転移温度(キュリー温度)を光の照射により変化するような温度(室温よりわずかに高い温度)に設定するなど、強磁性特性が所望の特性になるように作40 成する必要がある。

【0007】本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、赤色から遠赤外の光を透過するIII-V族系化合物を用いて、強磁性が得られる強磁性III-V族系化合物を提供することを目的とする。

【0008】本発明の他の目的は、強磁性 I I I-V族 系化合物を作成するにあたり、例えば、強磁性転移温度 などの、その強磁性特性を調整することができる強磁性 I I I-V族系化合物の強磁性特性を調整する方法を提 供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、赤色から 遠赤外の光を透過する材料として特に適した I I I-V 族系化合物を用い、強磁性特性を有する単結晶を得るた め鋭意検討を重ねた結果、V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Rh, またはRuなどの遷移金属元素は、GaやInのイオン 半径と近く、GaやInの25at%程度以上を置き換え(混晶 化させ)ても十分に単結晶が得られること、MnをIII -V族系化合物半導体に混晶させると、Mnの電子状態(d 電子5個)よりホールドープすることにより、強磁性が 得られること、Mnよりd電子が少なくなるCr, V などを I II-V族系化合物に混晶させることにより、高濃度にM nやホールを添加したのと同様の効果が得られることを 見出し、V, Crなどの遷移金属元素をIII-V族系化合 物に混晶化させることにより、これらの金属単体を混晶 させるだけで安定した従来のMnドープによるものより格 段高いキューリー点を持つ強磁性状態にすることができ ることを見出した。

【0010】そして、本発明者らがさらに鋭意検討を重 ねた結果、V, Cr. Mnなどの遷移金属元素は、電子スピ  $\nu s = 1$ , 3/2, 2をもつ高スピン状態となり、これ らの遷移金属元素の濃度や混合割合を調整することによ り、所望の磁気特性を有する単結晶性で、かつ、強磁性 のIII-V族系化合物が得られることを見出した。

【0011】すなわち、遷移金属元素の濃度を変化した り、これらの2種類以上の組合せや、その割合を変えた 混晶にしたり、n型および/またはp型のドーパントを添 加したりすることにより、強磁性転移温度を可変し得る こと、反強磁性や常磁性状態より強磁性状態を安定化さ せえること、その強磁性状態のエネルギー(例えば、僅 かの差で反強磁性になるが、通常は強磁性状態を維持す るエネルギー)を調整し得ること、遷移金属元素により 最低透過波長が異なり、2種類以上を選択的に混晶する ことにより、所望のフィルタ機能をもたせ得ること、を 見出した。

【0012】本発明による強磁性III-V族系化合物 は、III-V族系化合物において、VまたはCrよりなる 群から選ばれる少なくとも1種の遷移金属が I I I 族元 素を置換して混晶を形成している。

【0013】ここに、III-V族系化合物とは、Gaま たはInを含むヒ素化合物またはリン化合物、具体例とし 40 ることができる。 ては、GaAs, InAs, GaP, InPである。

【0014】この構成にすることにより、前述の遷移金 属元素はGaやInなどの I I I 族元素とイオン半径が近 く、GaやInの25at%程度以上を置換しても閃亜鉛鉱型構 造の単結晶を維持すると共に、赤色から遠赤外の光に対 しての透明性を維持しながら、閃亜鉛鉱型強磁性の性質 を呈する。

【0015】前記の遷移金属元素、およびTi, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Rh, またはRuよりなる群から選ばれる少な くとも1種の金属が含有されることにより、その金属元 50 による強磁性III-V族系化合物、およびその強磁性

素のd電子の状態がそれぞれ異なり、ホールまたは電子 をドープするよりも直接的に強磁性特性が変化し、強磁 性転移温度などの強磁性特性を調整することができる。 【0016】n型ドーパントまたはp型ドーパントの少な くとも一方がドーピングされても、ドーパントはIII -V族系化合物の母体に入るため、遷移金属元素間の影 響のように直接的ではないが、III-V族系化合物に 近いd電子に作用して、ホールまたは電子が変動し、そ の強磁性特性を調整することができる。

【0017】本発明によるIII-V族系化合物の強磁 性特性の調整方法は、GaAs, InAs, InP, またはGaPよりな る群から選ばれるIII-V族系化合物に、(1)Vまたは Crよりなる群から選ばれる少なくとも1種の遷移金属元 素(2) 前記(1) の遷移金属元素、およびTi, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Rh, またはRuよりなる群から選ばれる少な くとも1種のその他の遷移金属元素、または(3)前記 (1)または(2)の遷移金属元素と、n型ドーパントまた はp型ドーパントの少なくとも一方、のいずれかを添加 し、前記(1)、(2)、または(3)の元素の添加濃 度の調整により強磁性特性および/または強磁性転移温 度を調整することを特徴とする。

【0018】また、GaAs, InAs, InP, またはGaPよりなる 群から選ばれるIII-V族系化合物に、(1)VまたはCr よりなる群から選ばれる少なくとも1種の遷移金属元素 (2) 前記 (1) の遷移金属元素、およびTi, Mn, Fe, C o, Ni, Cu, Rh, またはRuよりなる群から選ばれる少なく とも1種のその他の遷移金属元素、のいずれかを添加 し、これらの添加金属元素の組合せにより強磁性特性お よび/または強磁性転移温度を調整することを特徴とす

【0019】また、前記(2)に列記される金属元素を混 晶させ、強磁性のエネルギーを調整すると共に、該金属 元素自身により導入されたホールまたは電子による運動 エネルギーによって全エネルギーを低下させることによ り、強磁性状態を安定化させることができる。

【0020】また、前記(2)に列記される金属元素を混 晶させ、遷移金属元素自身により導入されたホールまた は電子によって、金属原子間の磁気的相互作用の大きさ と符号を制御することにより、強磁性状態を安定化させ

【0021】さらに、前記(2)に列記される金属元素を 混晶させ、遷移金属元素自身により導入されたホールま たは電子によって、金属原子間の磁気的相互作用の大き さと符号を制御すると共に、遷移金属元素の混晶による 光の透過特性を制御することにより、所望の光フィルタ 特性を有する強磁性 I I I-V族系化合物とすることが できる。

#### [0022]

【発明の実施の形態】次に、図面を参照しながら本発明

10

20

40

特性の調整方法について説明をする。本発明による強磁性 I I I-V族系化合物は、VまたはCrよりなる群から選ばれる少なくとも 1種の遷移金属が I II-V族系化合物の III 族元素を置換して混晶を形成している。

【0023】前述のように、本発明者らは、III-V 族系化合物を用いて強磁性材料を得るために鋭意検討を 重ねた。その結果、VまたはCrの遷移金属元素は、反強 磁性を示すFeより3d電子が減することにより、図2に、 GaAsにおける反強磁性スピングラス状態の全エネルギー と強磁性状態の全エネルギーとの差△Eが示されるよう に、いずれも、VまたはCrのみを単独で混晶させるだけ で強磁性を示すことを見出した。

【0024】図2に示す混晶割合は、GaAsのGaに対して、5,10,15,20,25at%の例であるが、混晶割合としては、数%でも強磁性を示し、また、多くしても結晶性および透明性を害することがなく、1at%から100at%、好ましくは5at%~25at%であれば、充分な強磁性を得やすい。この遷移金属元素は1種類である必要はなく、後述するように2種類以上を混晶(合金化)することができる。

【0025】このような遷移金属元素を含有するGaAs化合物の薄膜を成膜するためには、例えば、図1に概略を示すようなMBE装置を使用することができる。MBE装置を用いて、 $1.33\times10^{\circ}$  Pa程度の超高真空を維持できるチャンバー1内の基板ホルダー4に、GaAs化合物を成長する、例えば、サファイアなどの基板5を設置し、ヒータ7により基板5を加熱できるようになっている。

【0026】そして、基板ホルダー4に保持される基板5と対向するように、成長する化合物を構成する元素の材料(ソース源)Gaを入れたセル2a、V, Crなどの遷移金属元素を入れたセル(1個しか示されていないが、2種類以上を混晶させる場合は2個以上設けられている)2b、n型ドーパントのSnを入れたセル2c、n型ドーパントのラジカル酸素0を発生させるRFラジカルセル3a、p型ドーパントであるZnを入れたセル2dが設けられている。なお、GaやInや遷移金属などの固体原料はこれらの金属の酸化物をセルに入れて加熱して原子状にすることもできる。

【0027】なお、固体(単体)を入れるセル2a~2eは、それぞれに加熱装置(図示されていない)が設けられ、加熱により固体ソースを原子状にして蒸発させられる様になっており、ラジカルセル3aは、図に示されるようにRF(高周波)コイル8により活性化させている。【0028】このGa、In、遷移金属元素およびn型ドーパント材料としては、純度99.9999%の固体ソースを原子状にし、また、0または励起状態の0は、0.分子。を前述のラジカルセルにより活性化して使用する。なお、Snや遷移金属元素は分子ガスにマイクロ波領域の電磁波を照射することにより原子状にすることもできる。

【0029】そして、GaAsを成長させながら、n型ドー

パントのSnを流量1.33×10<sup>5</sup> Paで、さらに、p型ドーパントである原子状2nを6.65×10<sup>5</sup> Paで、また、例えば、VまたはCrの原子状遷移金属元素を1.33×10<sup>5</sup> Paで、同時に、基板5上に流しながら、350~750℃で成膜することにより、VまたはCrを混晶させたGaAs薄膜6を成長させることができる。以上の説明では、n型ドーパントやp型ドーパントをドーピングする例で説明しているが、前述の図2および後述する表1および表2の例は、いずれのドーパントもドーピングしないで、VまたはCrのみをドーピングした例である。

【0030】このようにして、VまたはCrを混晶させたGaAs薄膜は、図2に示されるように、VまたはCrが、反強磁性スピングラス状態の全エネルギーと強磁性状態の全エネルギーとの差△Eが、それぞれ、1.3×13.6meV、2.1×13.6meVと大きく、強磁性を示していることが分かる。なお、図2のデータは、第一原理計算(原子番号を入力パラメータとしてシミュレーションする)によるデータであり、各遷移金属の濃度依存性を示してある。Fe, Co, Niは反強磁性スピングラスとなる。

【0031】この例では、GaAs化合物に遷移金属元素をドープさせたが、GaAsのGaの一部がInやBなどの他のIII族元素と置換したGaAs系化合物でも、GaAsと同様の構造であり、バンドギャップが異なるのみであり、同じように強磁性の単結晶が得られる。

【0032】本発明の強磁性GaAs系化合物によれば、Ga とイオン半径がほぼ同じの遷移金属元素を混晶させてい るため、Ga<sup>3\*</sup> が遷移金属元素のV<sup>2\*</sup> やCr<sup>2\*</sup> などと置換さ れて、閃亜鉛鉱型構造を維持する。しかも、VまたはCr は、Mnよりd電子が減少する電子構造になっており、図 2に示されるように、このままの状態で強磁性状態で安 定する。しかも、この強磁性GaAsは、後述する表1およ び表2にも示されるように、その磁気モーメントが大き く、3.00×9.274J/T (3.00 μB (ボーア磁子) ) の磁気 モーメントを持つCr含有GaAs系化合物が得られ、非常に 磁性の強い強磁性磁石が得られる。なお、図6は、GaAs 中のVの電子状態密度であり、ハーフメタリック(上向 きスピンがメタルで下向きスピンは半導体) 状態を示し ている。また、図7は、GaAs中のCrの電子状態密度であ り、ハーフメタリック(上向きスピンがメタルで下向き スピンは半導体) 状態を示している。

【0033】次に、VまたはCrの濃度を変えることによる磁気特性の変化を調べた。前述の25at%濃度の遷移金属元素を含有させたものの他に濃度が5,10,15,20at%のものを作製し、それぞれの磁気モーメント( $\times$ 9.247J/T)および強磁性転移温度(度K)を調べた。磁気モーメントおよび強磁性転移温度はSQUID(superconducting quantum interference device;超伝導量子干涉素子)による帯磁率の測定から得られたものである。

【0034】その結果が表1および表2に示されてい 50 る。表1および表2から、混晶割合が大きくなる(濃度

が高い) ほど強磁性転移温度が上昇する傾向が見られ、 混晶割合にほぼ比例して増加する。この関係を図3に示 す。また、スピン間の強磁性的相互作用も遷移金属元素\*

\* 濃度の増加に伴って増大する。

[0035]

【表1】

遷移金属の	遷移金属の	磁気モーメン	強磁性転移
種類	濃度(at%)	ト(μ <sub>B</sub> )	温度(度 K)
v	5	2.00	35
Cr	5	3.03	80

[0036]

※10※【表2】

遷移金属の	遷移金属の 濃度(at%)	磁気モーメン ト(µB)	強磁性転移 温度(度 K)
種類 V	25	2.00	420
Cr	25	3.00	720

40

【0037】前述のように、VまたはCrは、電子スピン s=1, 3/2, 2をもつ高スピン状態となり、この表 1および表2、ならびに図3からも明らかなように、そ の濃度を変化させることにより、強磁性的なスピン間相 20 互作用と強磁性転移温度を調整し、制御することができ ることが分かる。なお、強磁性転移温度は、300度K以上 になるようにすることが、実用上好ましい。

【0038】さらに、本発明者らは、VまたはCrの少な くとも1種とその他の反強磁性の遷移金属元素を1種以 上混晶させることにより、ホールや電子の状態を調整で きると共に、それぞれの磁気特性を併せもたせることが できることを見出した。例えば、VまたはCrとその他の 反強磁性のFeを混晶させ、VとFe、CrとFeを合わせて25a t%とし、V<sub>0,25-x</sub> Fe<sub>x</sub> Ga<sub>0.75</sub> Asのxを種々変化させた。そ 30 の結果、図4に示されるように、強磁性転移温度を大き く変化させることができ、x=0.12で0度Kとすることが でき、x=0~0.12の範囲を選定することにより、所望の 強磁性転移温度に設定することができる。

【0039】また、CrとFeを同様に合わせて25at%混晶 させ、Cro.25-x FexGao.75 Asのxを種々変化させることが できる。また、図示されていないが、磁気モーメントに ついても両者の混合割合に応じた磁気モーメントが得ら れる。

【0040】前述の各例は、VまたはCrの少なくとも1 種とその他の反強磁性の遷移金属元素を1種以上ドープ することにより、その強磁性特性を変化させたが、n型 ドーパントまたはp型ドーパントをドープしても、同様 にホールまたは電子の量を変化させることができ、その 強磁性状態を変化させることができる。この場合、n型 ドーパントまたはp型ドーパントは、GaAsの伝導帯や価 電子帯に入り、その近くにある遷移金属元素のd 電子に 作用するため、必ずしもドーピングされたドーパントが そのまま全て作用することにはならないが、d電子に作 用することにより、その強磁性状態を変化させ、強磁性 50 転移温度にも変化を与える。

【0041】例えば、n型ドーパントをドープすること により、電子を供給したことになり、VやCrを混晶させ ながらn型ドーパントをドープすることは、前述のVやCr にさらにFeを添加するのと同様の効果が得られ、Crと共 にp型ドーパントをドープすることは、前述のCrにVを添 加するのと同様の効果が得られる。

【0042】例えば、n型ドーパントまたはp型ドーパン ト(電子またはホール)のドーピングによる(反強磁性 スピングラス状態の全エネルギー) - (強磁性状態の全 エネルギー) = △E、の変化が顕著であるCrをGaAsに混 晶させた例で、不純物をドーピングしたときの不純物濃 度(at%)に対する△Eの関係を図5に示す。

【0043】このように、ホールの導入により強磁性が 安定化し、一方、電子ドープにより強磁性が消失するの で、その強磁性特性を調整することができる。Vなどの 遷移金属元素は、元々強磁性を示し、反強磁性スピング ラス状態との間でこれほど大きな変化はないが、同様の 強磁性状態を変化させることができ、強磁性転移温度を 調整することができる。なお、このドーパントによる調 整は、前述の遷移金属を混晶する調整と異なり、磁気モ ーメントそのものはGaAsに混晶させた遷移金属の種類に より定まる値を維持する。

【0044】n型ドーパントとしては、Sn, Se, S, Teも しくはHを使用することができ、ドーピングの原料とし ては、これらの酸化物を使用することもできる。また、 ドナー濃度としては、1×10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup> 以上であることが好 ましい。例えば、 $10^{20} \sim 10^{21} \text{ cm}^{-3}$  程度にドープすれば、 前述の混晶割合の1~10%程度に相当する。また、p型ド ーパントとしては、前述のように原子状Znを用いること ができる。この場合、p型ドーパントはドーピングしに くいが、n型ドーパントを同時に僅かにドーピングする ことにより、p型濃度を大きくすることができる。

【0045】本発明者らは、さらに鋭意検討を重ねた結

10

果、III-V族系化合物に混晶させる遷移金属がVかCrかにより、その透過する最小の波長が異なり、VまたはCrの少なくとも1種とその他の遷移金属元素を1種類以上混晶することにより、光の透過特性である透過率や屈折率はあまり変わらないものの透過する光の最小波長を調整することができ、所望の波長以下の光をカットする光フィルタを形成することができることを見出した。

【0046】すなわち、所望の波長の光を透過させる強磁性のIII-V族系化合物が得られる。VまたはCrを25 at%GaAsに混晶させたときの透過する光の最小波長は表 10 3に示す通りになった。

[0047]

#### 【表3】

遷移金属の種類	遷移金属の濃	最小波長
	度 (at%)	(nm)
GaAs: V	25	700
GaAs: Cr	25	650

すなわち、この例によれば、所望の波長の光に対して、 透明な強磁性磁石を得ることができる。

【0048】以上のように、本発明によれば混晶される 金属元素自身などにより導入されたホールまたは電子の 運動エネルギーによって、全エネルギーを変化させることができ、その全エネルギーを低下させるように導入するホールまたは電子を調整しているため、強磁性状態を 安定化させることができる。また、導入されるホールまたは電子によって金属原子間の磁気的相互作用の大きさおよび符号が変化し、そのホールまたは電子によってこれらを制御することにより、強磁性状態を安定化させることができる。

【0049】前述の例では、III-V族系化合物の薄膜を成膜する方法として、MBE(分子線エピタキシー)装置を用いたが、MOCVD(有機金属化学気相成長)装置でも同様に成膜することができる。この場合、Ga, Inや遷移金属などの金属材料は、例えば、ジメチルガリウムやジメチルインジウムなどの有機金属化合物として、MOCVD装置内に導入する。このようなMBE法やMOCVD法などを用いれば、非平衡状態で成膜することができ、所望の濃度で遷移金属元素などをドーピングすることができる。

【0050】成膜の成長法としては、これらの方法に限らず、Ga、In固体、遷移金属元素金属または化合物の固体をターゲットとし、活性化したドーパントを基板上に

吹きつけながら成膜するレーザアブレーション法でも薄 膜を成膜することができる。

【0051】さらに、遷移金属元素やその酸化物を原料としてドープする場合、ラジオ波、レーザ、X線、または電子線によって電子励起して原子状にするECRプラズマを用いることもできる。n型ドーパントやp型ドーパントでも同様にECRプラズマを用いることができる。このようなECRプラズマを用いることにより、原子状にして高濃度までドープすることができるというメリットがある。

#### [0052]

【発明の効果】本発明によれば、III-V族系化合物にVまたはCrの少なくとも1種を含有させるだけで、強磁性単結晶が得られるため、すでに実現しているn型およびp型の透明電極として使用されているZnOや透明伝導酸化物(TCO)、光ファイバと組み合わせることにより、量子コンピュータや大容量光磁気記録、また、可視光から紫外領域に直る光エレクトロニクス材料として、高性能な情報通信、量子コンピュータへの応用が可能と20 なる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の強磁性III-V族系化合物薄膜を形成する装置の一例の説明図である。

【図2】V、Crなどの遷移金属をGaAsに混晶させたときの反強磁性スピングラス状態の全エネルギーと強磁性状態の全エネルギーとの差△Eを示す図である。

【図3】GaAsに混晶させる遷移金属の濃度を変えたときの強磁性転移温度の変化を示す図である。

【図4】2種類以上の遷移金属元素を混晶させたときの つ その割合による強磁性転移温度の変化の状態を説明する 図である。

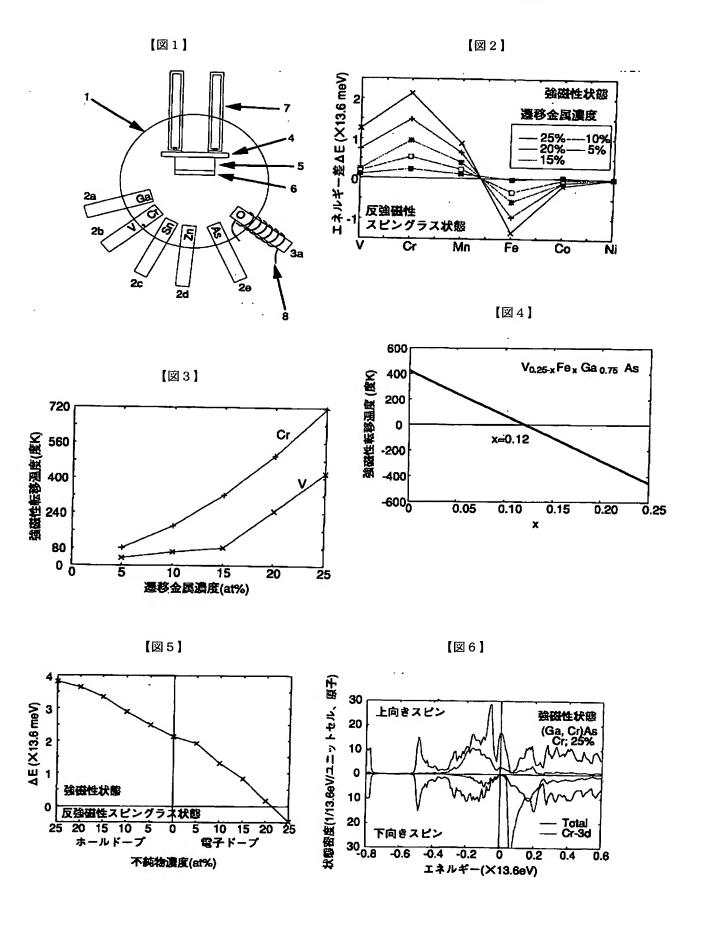
【図5】Crを例としたn型またはp型のドーパントを添加 したときの磁性状態の変化を示す説明図である。

【図6】GaAs中のVの電子状態密度であり、ハーフメタリック(上向きスピンがメタルで下向きスピンは半導体)状態を示す図である。

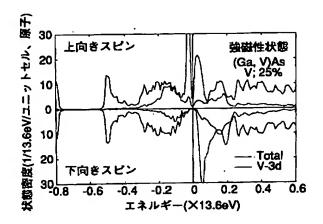
【図7】GaAs中のCrの電子状態密度であり、ハーフメタリック(上向きスピンがメタルで下向きスピンは半導体)状態を示す図である。

#### 40 【符号の説明】

- 1 チャンバー
- 2,3 セル
- 5 基板
- 6 VおよびまたはCrを混晶したGaAs薄膜



【図7】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】 平成16年8月12日(2004.8.12)

【公開番号】特開2002-255695(P2002-255695A)

【公開日】平成14年9月11日(2002.9.11)

【出願番号】特願2001-59195(P2001-59195)

【国際特許分類第7版】

C 3 0 B 29/40

G 1 1 B 11/105

[FI]

C 3 O B 29/40

Α

G 1 1 B 11/105 5 0 6 Z

#### 【手続補正書】

【提出日】 平成15年7月18日(2003.7.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.